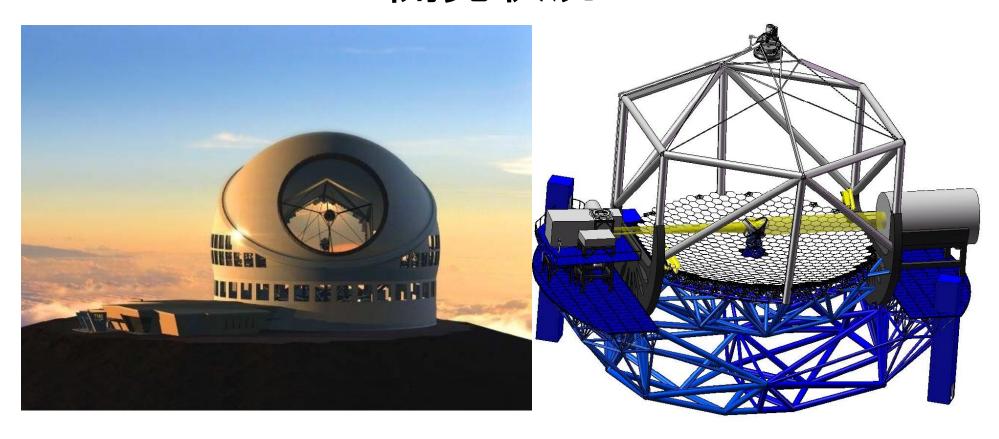
## TMTの概要と日本のセグメント主鏡 開発状況



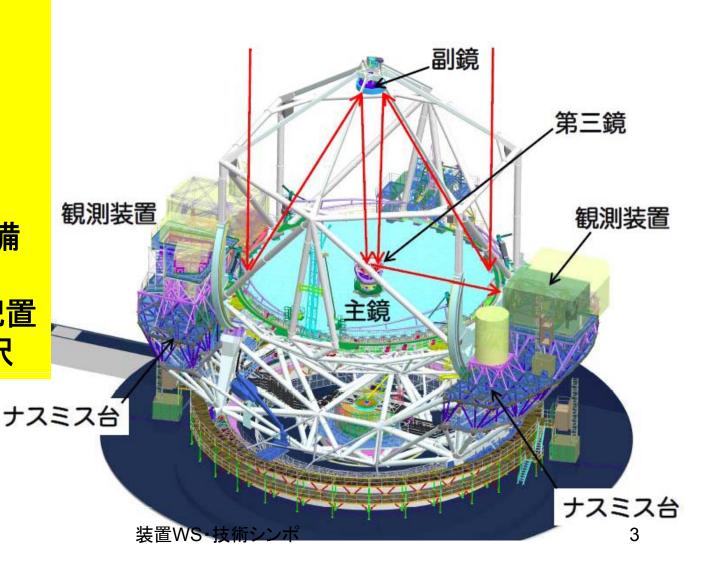
国立天文台·TMT推進室 山下卓也

## TMTの概要

2

## TMTの構造の特徴

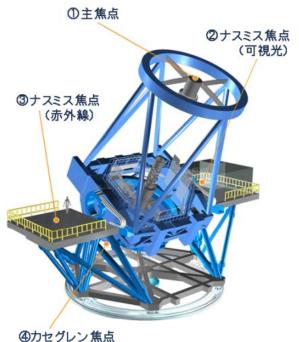
- •主鏡直径:30m
- 492枚分割鏡で 軽量化
- ロ径比1.0で コンパクト化
- ・レーザーガイド 補償光学を装備
- ・観測装置は全て ナスミス台に配置
- ・第3鏡で装置選択



TMT

幅 60m

高さ 51m すばる望遠鏡 幅 27.2m 高さ22.2m



(c) MBTA Corporation Japan #150132

大きさ比べ

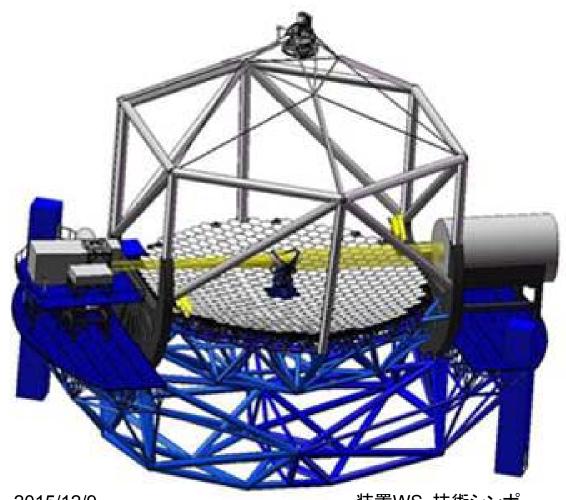
主鏡径 3.8倍

幅 2.2倍

高さ 2.3倍

重量比べ

2200t/550t 4倍



2015/12/9

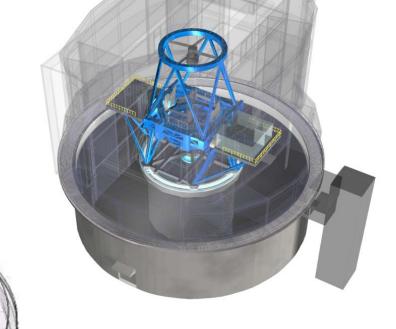
装置WS・技術シンポ

TMTドーム

直径 66m

高さ 56m

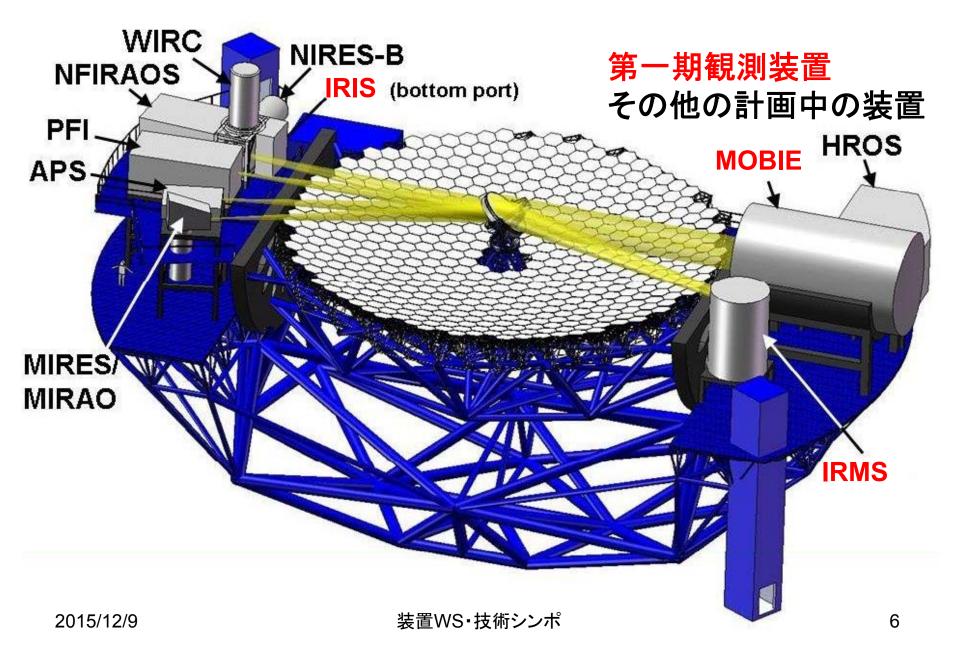
すばるドーム 直径40m 高さ43m



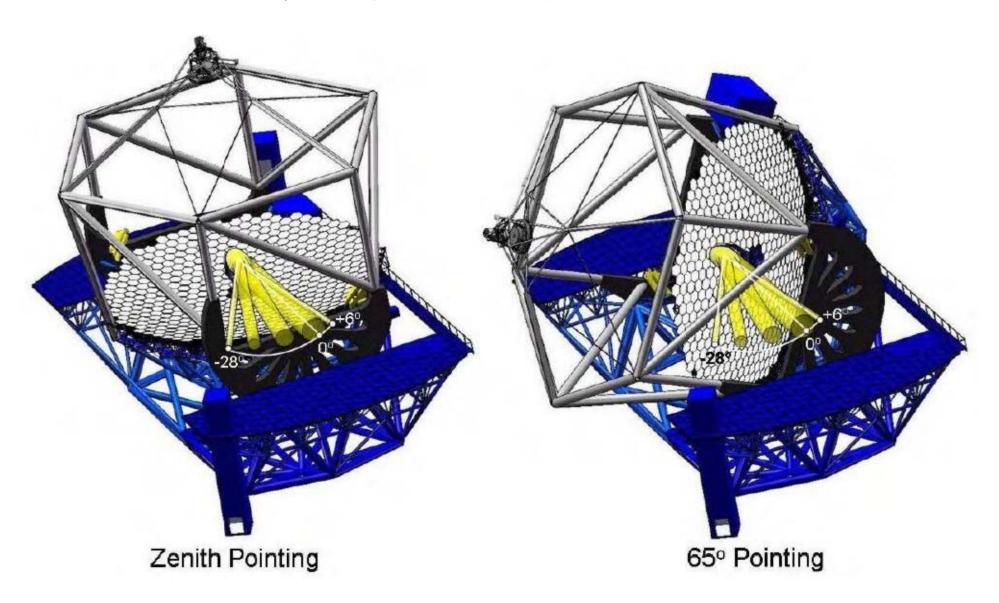
(c) 2003 META Corporation Japan #150102

大きさ比べ ドーム径1.7倍 ドーム高さ1.3倍

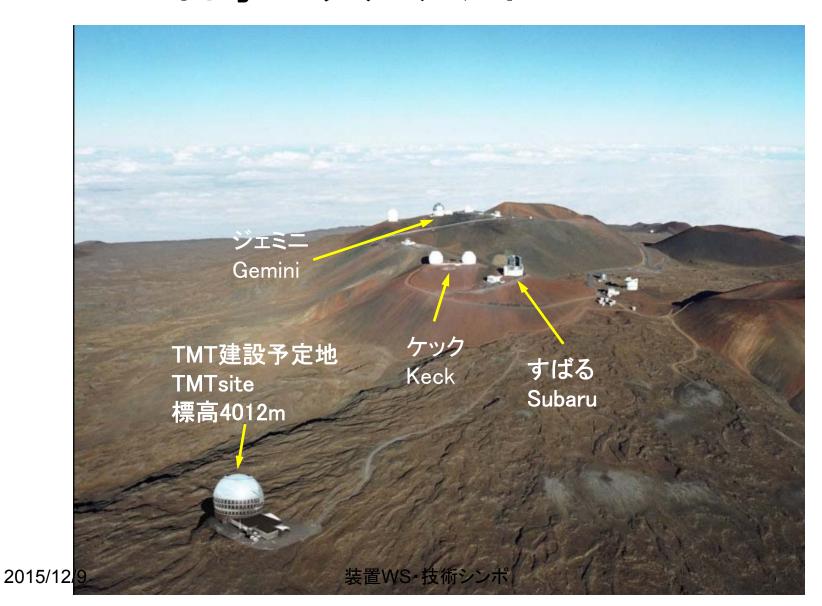
## 観測装置レイアウト



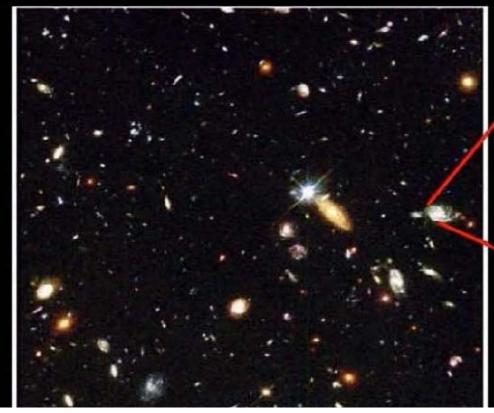
## 観測装置の切り替え



## TMT建設地 TMT site ハワイ島マウナケア山 MaunaKea

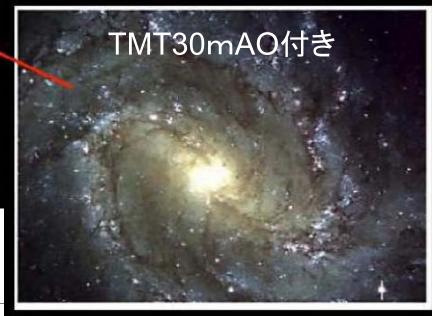


## TMTの威力: 大集光力と高解像度

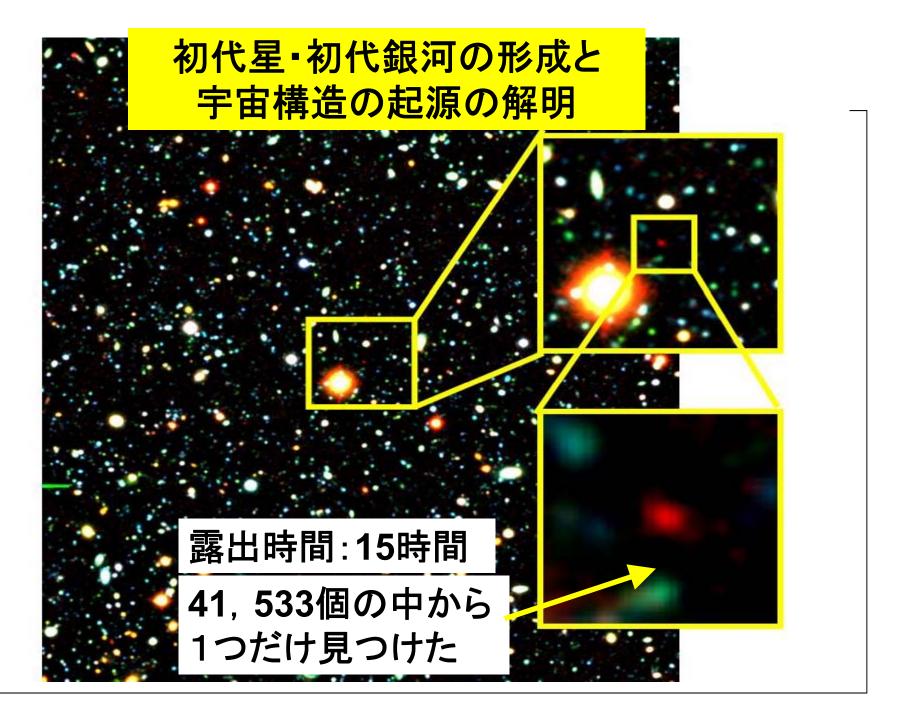


TMTの解像度=すばるの4倍 TMT の感度=すばるの14倍~200倍 回折限界での効率 ~ 口径4





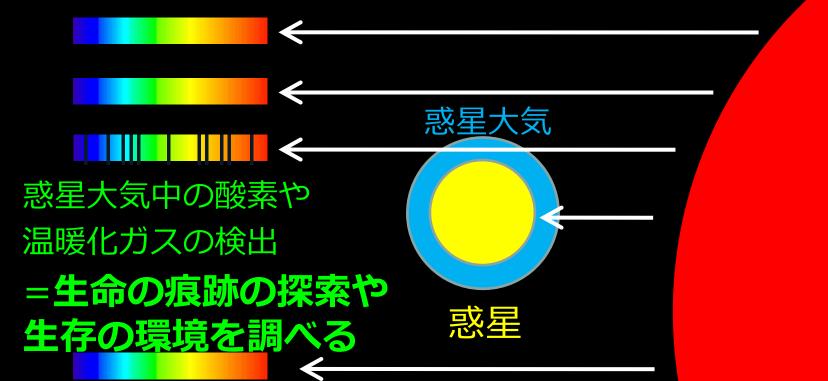
The same with a 30 meter telescope & Adaptive Optics



## TMTによる地球外生命探し

- ► TMTは系外惑星の大気を分光しその成分を調べることができる。
- 酸素などのバイオマーカー、および温暖化ガスが発見されれば、 地球外生命の可能性も…

恒星のスペクトル



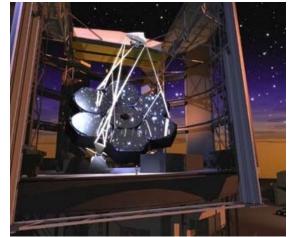
4

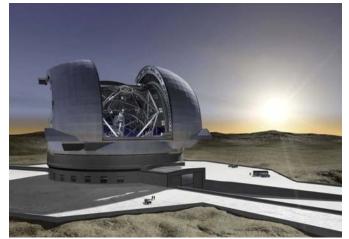
主星

## 世界の次世代超大型望遠鏡計画

計画	TMT	GMT	E-ELT
直径	30m	22m(8.4mx7)	39m
建設地 (標高)	ハワイ:マウナケア (4050m) 北の宇宙	チリ:ラスカンパナス (2550m)南の宇宙	チリ: セロアルマソネス (3060m) 南の宇宙
予算規模	1,500億円	1,100億円(推定額)	2,000億円(推定額)
完成予定	平成36年?	平成33年 (注:7枚の内、4枚で初期運用)	平成37年
メンバー	日本、米国、カナダ、中国、インド	米国(カーネギー天文台、 ほか)、韓国、オーストラリ ア、ブラジル・サンパウロ州	欧州南天天文台 (15ヶ国)







12

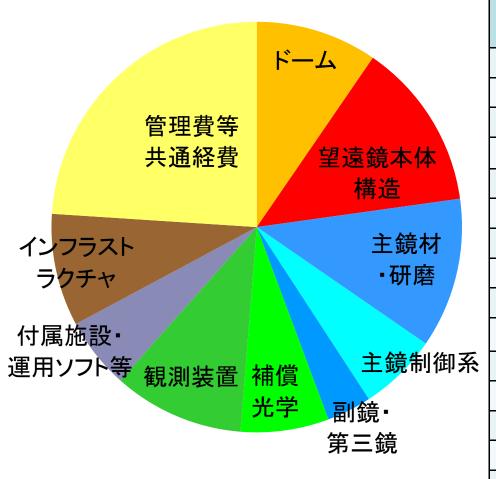
装置WS・技術シンポ 2015/12/9

## 国際協力で実現

## 建設期経費の内訳と役割分担

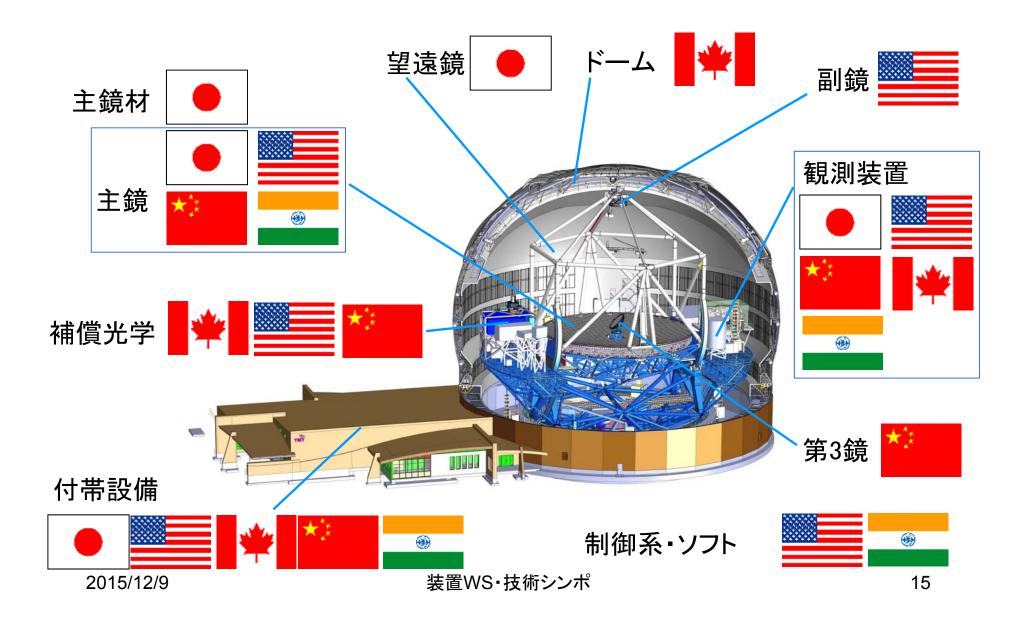
建設期経費(約1500億円)の内訳

建設における役割分担



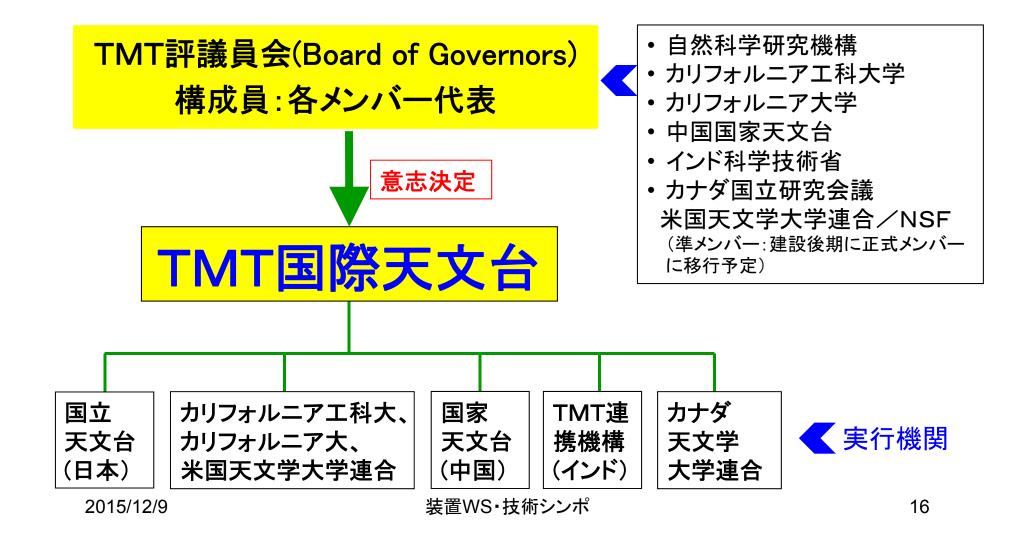
	日本	米国	中国	インド	カナダ
山頂施設	0	0	0	0	0
山麓施設	0	0	0	0	0
ドーム					0
望遠鏡製作・組立	0				
主鏡材	0				
主鏡研磨	0	0	0	0	
主鏡支持機構				0	
副鏡		0			
第三鏡			0		
鏡洗浄蒸着機構				0	
主鏡制御		0		0	
望遠鏡制御	0			0	
補償光学					0
レーザー			0		
観測装置	0	0	0	0	0
観測所人件費等	0	0	0	0	0

## TMTにおける国際協力



#### TMT国際天文台(TIO)の設立

- 各メンバーの代表で構成されるTMT評議員会が意思決定を行う。
- 望遠鏡構造・主鏡等の製造はTIOとの契約の形で実施。



# 主鏡以外の日本の主な貢献

## 日本の寄与:望遠鏡本体

● すばる望遠鏡製作の実績を踏まえた各国の要請による TMT望遠鏡本体構造および制御系の設計・製作・現地据 付・試験

● 軽量堅固なトラス構造

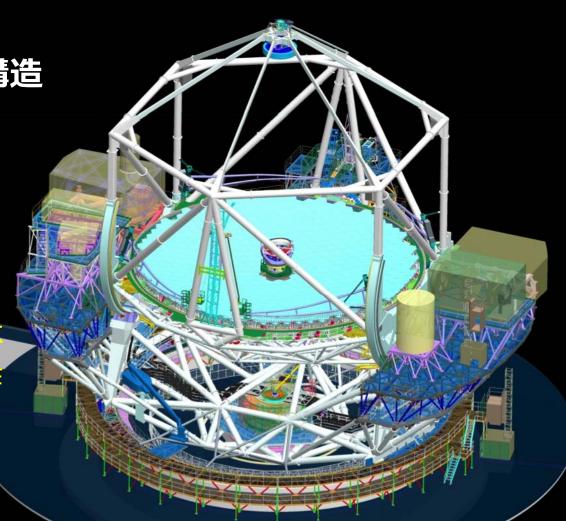
● 高い追尾/指向精度

主鏡着脱機能

● 主鏡CO2洗浄機能

免震安全機構

望遠鏡の要となる本体 構造を日本が設計製作

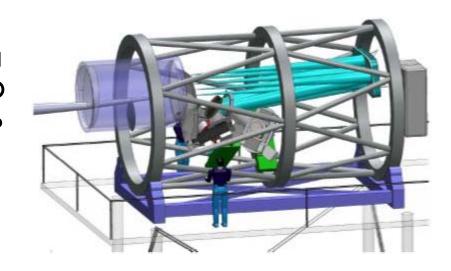


この図の副鏡・第三鏡・観測装置以外を担当

## 第一期観測装置開発

- 1) 近赤外線撮像分光装置の撮像系
- 2) 可視多天体分光装置のカメラシステム



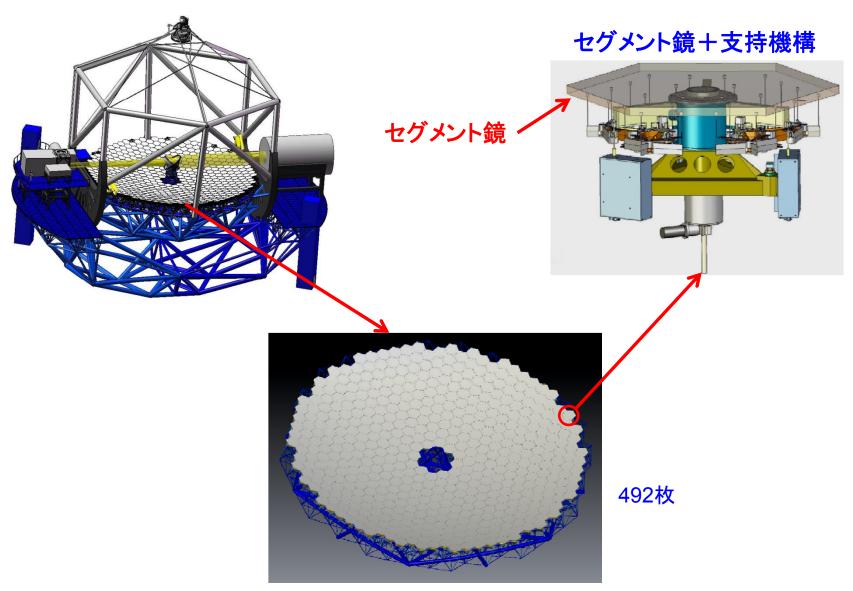


可視多天体分光装置

近赤外線撮像分光装置 2015/12/9

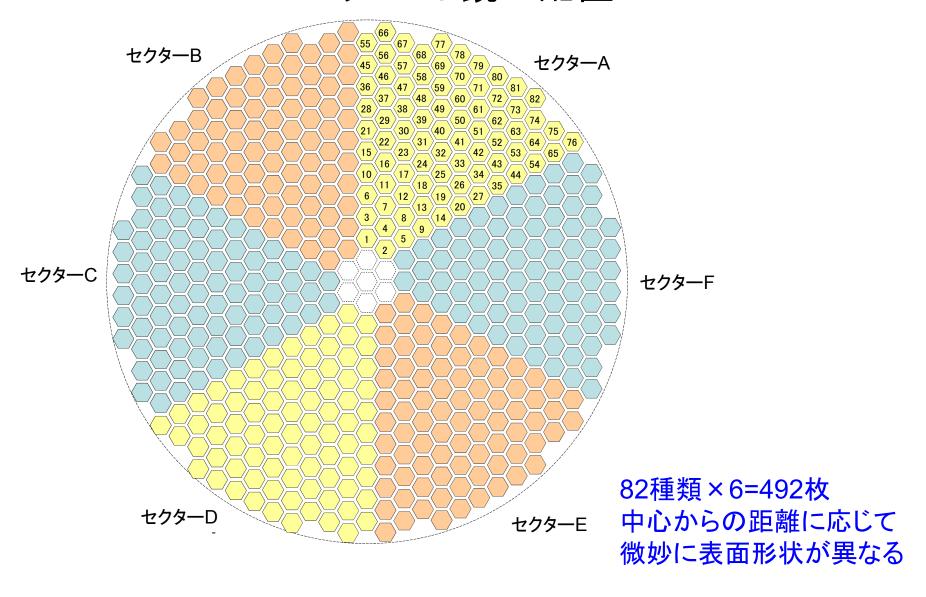
## TMTの主鏡

## TMT望遠鏡のセグメント主鏡(分割鏡)



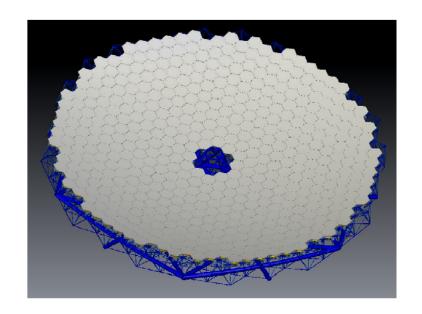
TMT望遠鏡の30m主鏡 装置WS・技術シンポ

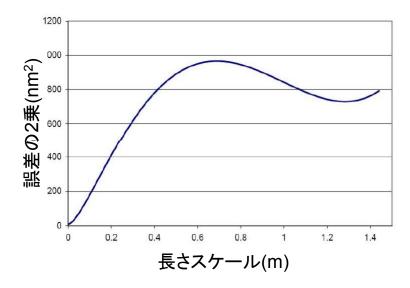
#### セグメント鏡の配置



## セグメント鏡の仕様

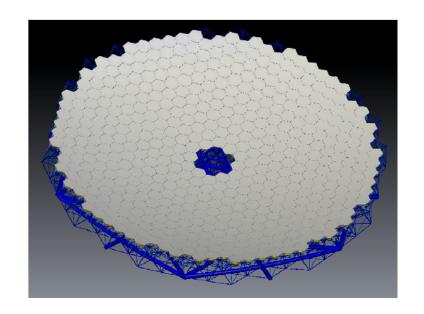
- 492セグメント(+蒸着交換用82枚)
  - 82種類×(6(+1)枚)
- ・ 単体のセグメント鏡
  - 対角長:約1.44m、厚さ45mm
  - 仕上げ面精度:
    - ・ 右図の構造関数(旧仕様)





## セグメント鏡のメリット・デメリット

- ・メリット
  - 単一鏡では製作できない口径の鏡を製作できる
  - 鏡の厚さを非常に薄くできる
    - すばる 200mm v.s. TMT 45mm
    - ・ 主鏡重量を軽減できる
      - → 全体重量を軽減できる
    - 熱慣性を小さくできる
      - → 温度追随性の向上
      - → シーイングの劣化を軽減



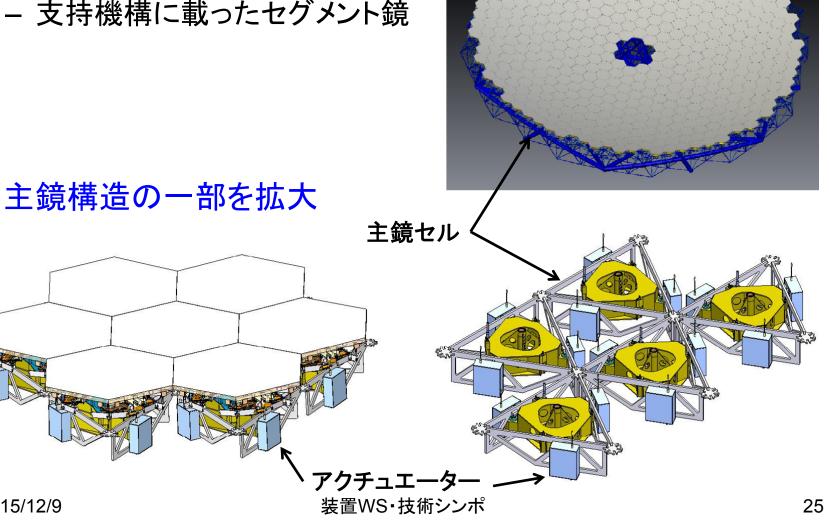
- ・デメリット
  - 製作が容易ではない
  - セグメント鏡間の位置調整(位相合わせ)が容易ではない

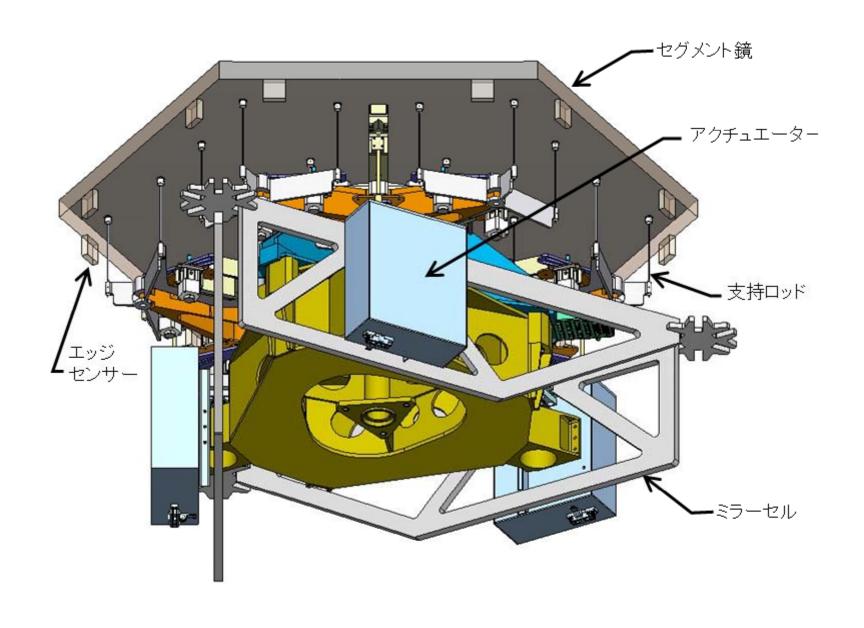
## TMTのセグメント主鏡

・ 主鏡の構成

2015/12/9

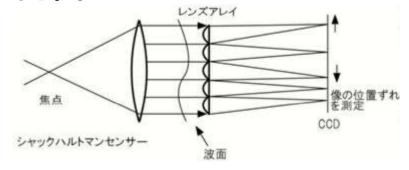
- 主鏡セル
- 支持機構に載ったセグメント鏡





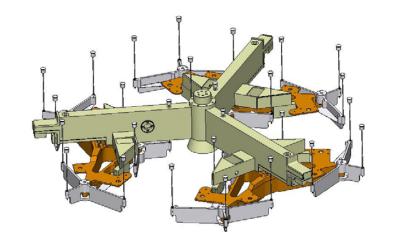
## セグメント鏡の制御

- ・ セグメント鏡面の形状
  - シャックハルトマン法で計測



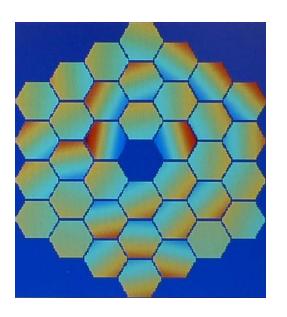
- 支持機構のウイッフルツリーのアームにモーメントを掛けて変形

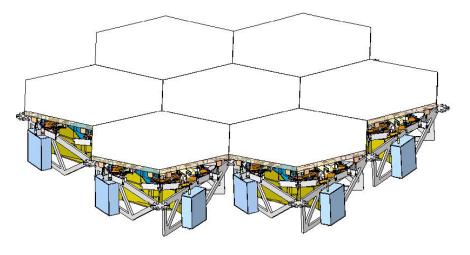
- 観測中は制御しなくても良い予定



## セグメント鏡の制御

- セグメント鏡間の段差
  - まず、光学的な方法で測定
    - ・ 隣り合う面の干渉パターンから
  - 3本のアクチュエーターの長さ(高さ)制御
  - セグメント鏡の隣り合う面にエッジセンサー
    - 観測中はエッジセンサーにもとづいて制御
    - ・ 光学的測定はエッジセンサーの原点決定

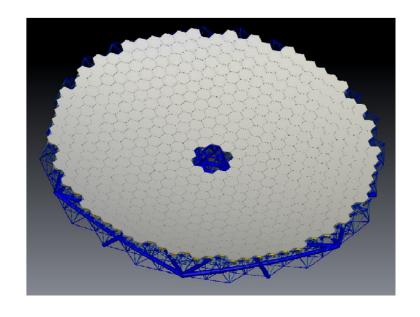




## 主鏡に関する日本の貢献

## 日本の貢献

- ・ 主鏡・鏡材の製造
  - 日本が100% (574枚)
  - 球面研削加工までを含む
- ・ 主鏡セグメント鏡の研磨加工
  - 日本が30%(175枚)
  - 米国40%
  - 中国15%
  - インド15%
  - 最終仕上げ(IBF加工)は米国100%

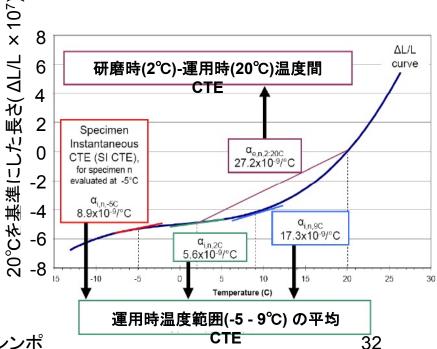


## 主鏡に関する日本の貢献鏡材

31

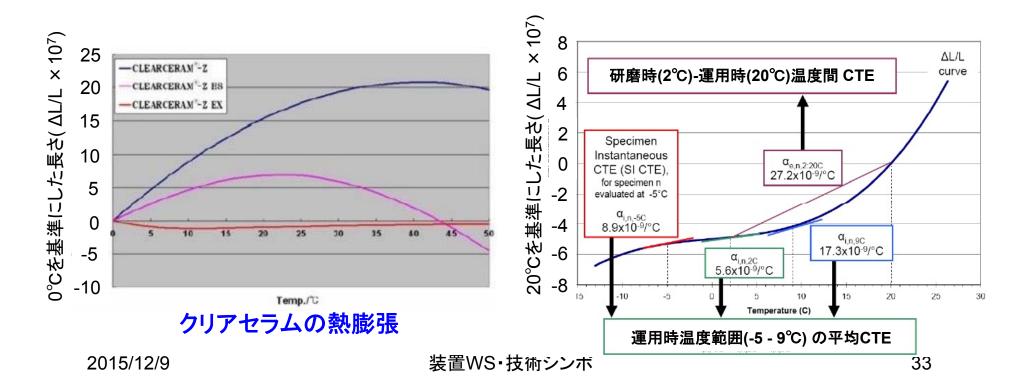
## 日本のセグメント鏡開発:鏡材

- 主鏡鏡材:超低膨張ガラス
  - 温度変化による鏡面変形を起こさないように
    - ・ 鏡面研磨加工時の温度: ~20℃
    - 運用時の温度:平均2℃ (-5 9℃)
  - 膨張係数(CTE: Coefficient of Thermal Expansion)
    - 0±4×10<sup>-8</sup> K<sup>-1</sup> (-5,2,9℃の平均)
  - CTEの鏡材間の分散(研磨一使用温度間)
    - 0±2.5×10<sup>-8</sup> K<sup>-1</sup> (2-20°C間)
  - CTEの分布の仕様など



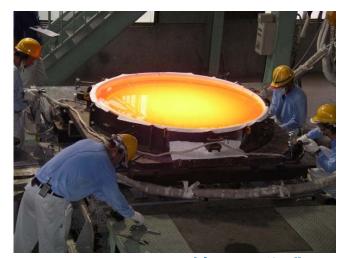
## 日本のセグメント鏡開発:鏡材

- 主鏡鏡材
  - 日本のオハラ社のクリアセラム HS
  - 但し、微妙に仕様が異なる
    - 使用温度範囲
    - 残留応力の仕様・測定点数
  - 通常のクリアセラムのプロセスを改良して量産試作



## 日本のセグメント鏡開発:鏡材

- 鏡材
  - 形状
    - Φ1520, t46 のメニスカス形状(曲率半径=62.5m)
  - 技術開発がほぼ完了
    - 1世代前の炉では脈理の問題があったが、新しい炉では解決
    - 米国TMTで研磨試験・温度試験
  - 鏡材の全量(574枚)を日本が供給
    - すでに量産能力を持っている
    - ・ (炉の寿命もあり)この量産に合わせて 設備更新を予定

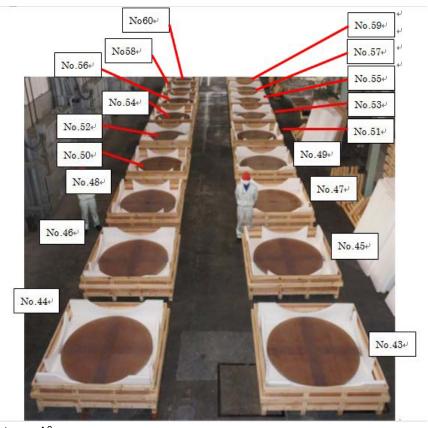


クリアセラムの鋳込み作業

## 鏡材の量産

• 2012年度から順調に生産中

工程	2013	2014	2015	<b>2015年度</b>
	年度	年度	年度予定	まで合計
鏡材の製作	60	39	65	164/574



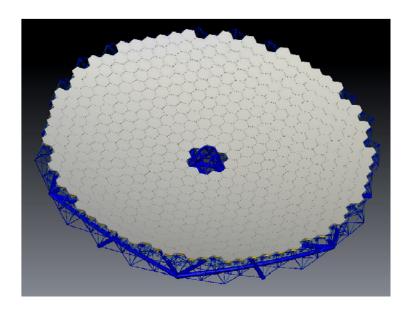
## 主鏡に関する日本の貢献セグメント鏡加工

## セグメント鏡加工特有の問題点

- 全体で1枚の鏡である
- ・ "ふち"問題
  - "ふち"が"ふち"でない
    - "ふち"まで完全に研磨
  - 研磨後、6角形に切断
    - 切断による変形 → 修正研磨
  - 6角形に切断後、研磨
    - "ふち"まで正確な研磨: "やとい"

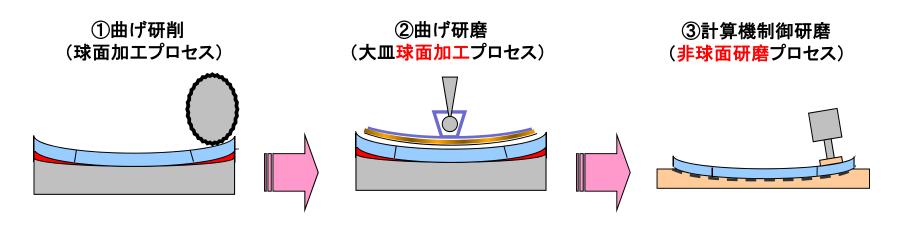


- すべてのセグメント鏡の形状が連続的でなければならない。
- 3次元計測器(非干渉計法)
  - 正確な曲率測定は得意
  - 1つの方法を信じるのは危険
    - 干渉計測定法の併用 or 干渉計測定法による検証



## フルサイズセグメント鏡の試作(2010-2011年度)

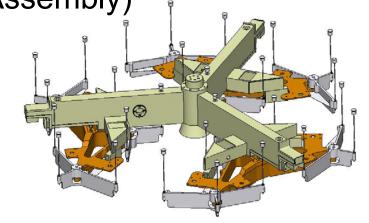
- 試作の加工工程
  - 6角形にカット(鏡面測定装置のサイズによる制限)
  - 曲げ研削・研磨(ケック望遠鏡で採用された方法)は採用せず
    - 球面と非球面の差の分だけ鏡材を曲げる
    - ・この状態のまま、球面研削・研磨
    - 曲げを解放する → 非球面形状
  - 計算機制御研磨(Computer Control Polishing)
    - 鏡面測定にもとづいて残差を、研磨の滞留時間制御で研磨

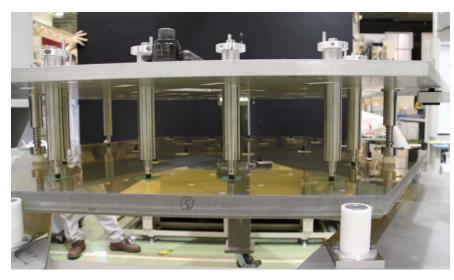


## 試作鏡の支持機構への搭載(2012年度)

• 支持機構(SSA: Segment Support Assembly)

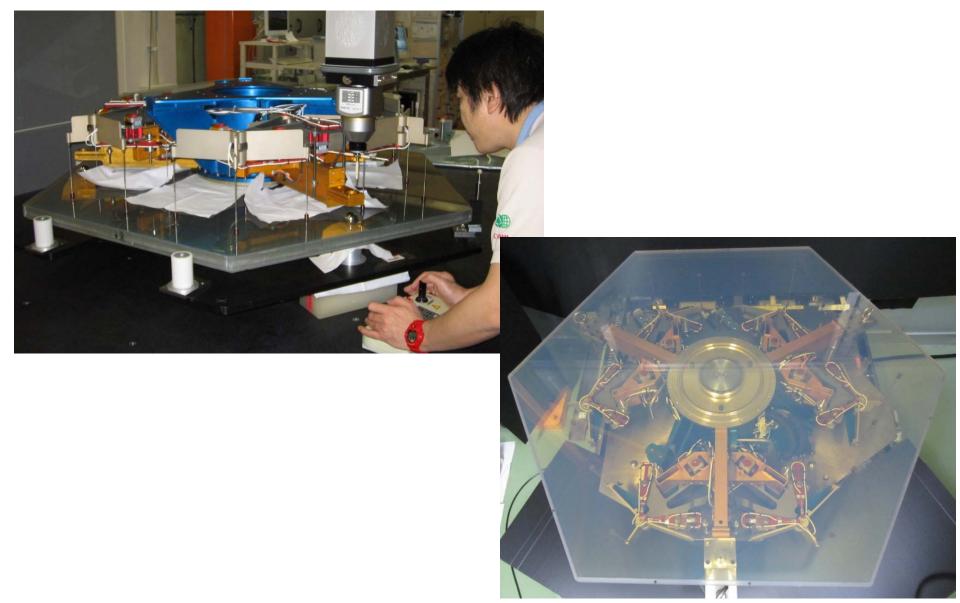
- 米国TMT設計·製作
- 量産はインド担当の予定
- 搭載には専用の治具を用いる
  - 位置精度•再現性





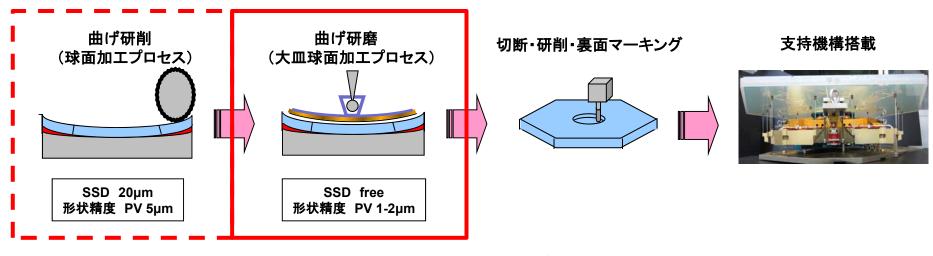


## 試作鏡の支持機構への搭載(2012年度)



## 量産工程での曲げ研磨法の採用

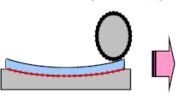
- 米国TMTの推奨してきた曲げ研磨の採用へ
  - 球面と非球面の差分形状だけ鏡材を曲げる
  - 球面研磨する(高速)
  - 曲げを解放すると非球面に
- 選択理由
  - 小スケールの厳しい仕様にはSmall toolを使わないのが望ましい
  - 6角形切断や支持機構搭載での変形があるので、曲げ研磨で十分
  - 研磨効率が良いので生産性が良い



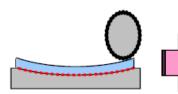
## セグメント鏡の加工工程

#### 日本の分担範囲

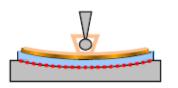
① #200球面研削 (カーブジェネレータ)



② #800球面曲げ研削 (ロータリー研削機)

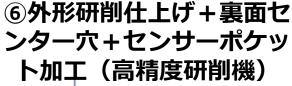


③ 大皿球面研磨 (曲げ研磨)

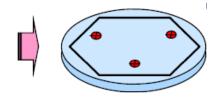


形状精度 PV < 1μm

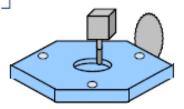
⑤ ミラー面マーキング +外形基準加工 (高精度研削機)

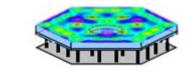


⑦ 専用支持機構搭載







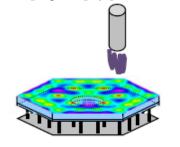


形状精度 PV < 2μm

⑧ CGH干渉計測+IBF研磨

米国へ移送

最終仕上げ



SSA: Segment Support Assembly (セグメントミラー保持機構)

**CGH:** Computer Generated Hologram )

**IBF: Ion Beam Figuring** 

## 曲げ機構の設計・製作

## 曲げ研磨の採用・試作

- ・ 2次元形状測定器の導入
  - TMT-Tinsleyで開発
  - Zernike15項までの測定:
    - 測定精度:0.65µm
    - 鏡面仕様:PV 2µm以下
  - 12/14の週にキヤノンで受け入 れ試験予定

2次元形状測定器

## 曲げ研磨のFRR(2015年10月6,7日)

- Fabrication Readyness Review
  - 合格 → 研磨加工の量産OK
    - ただし、詳細については今後の検討・改善が必要

## セグメント鏡の量産状況

- 製造工程と国別の割当
  - 鏡材の製作
  - 球面研削
  - 非球面研削
  - 非球面研磨
  - 外形加工:6角形切断他
  - 支持機構への搭載
  - 最終仕上げ研磨

日本が100%(574枚)

日本が30%(175枚) 米国40%,中国15%, インド15%

米国が100%(574枚)

#### 今年度までの量産状況

工程	2013 年度	2014 年度	2015 年度予定	<b>2015年度</b> まで合計
鏡材の製作	60	39	65	164/574
球面研削	12	19	63	94/574
非球面研削	12	16	31	59/175
非球面研磨			7	7/175